

職務経歴書

20××年××月××日現在

氏名 ○○ ○○

■職務要約

入社以来○年エッチングプロセスの開発に取り組んでまいりました。○年からはサブリーダーとして工程管理や協力会社やメンバーのマネジメントを中心に予算やリスク管理などプロジェクトマネジャーの職務の一部にも携わっております。

■職務経歴

□19××年××月～現在 ○○○○株式会社

◆事業内容:半導体製造装置の開発、製造、販売

◆資本金:○○○百万円 売上高:○○○百万円(20××年) 従業員数:○○○名 上場

期間	担当製品	担当業務	環境/ツール	メンバー/役割
19xx年xx月 ～ 20xx年xx月	液晶向けプラズマ エッチング装置	低温ポリシリコン TFT 向けのエッチングプロセス 開発 ・評価試験、データ解析を担当	電子顕微鏡、蛍光X 線元素分析装置	メンバー:10名
20xx年xx月 ～ 20xx年xx月	液晶向けプラズマ エッチング装置	2周波 RIE 開発 ・酸化膜プロセス開発 ・プラズマ密度分析の制御技術開発 ・パワー効率の向上のためのチャンバー構造見 直し	ネットワークアナライ ザー、プラズマ電 子密度測定、電子 顕微鏡、蛍光 X 線 元素分析装置	メンバー:8名
20xx年xx月 ～ 現在	半導体エッチング 装置	CVD プロセス技術開発(○○大学との共同研究) ・Yield 改善に特化した新規製品の開発 ・Wsix、PE-SiO2 成膜プロセス開発	電子顕微鏡、蛍光X 線元素分析装置	サブリーダー/メンバー5名

■活かせる経験・知識・技術

- ・ドライエッチング、CVD エッチングプロセス開発技術(20××年 優秀社員賞受賞)
- ・サブリーダーとしてプロジェクト工程管理、協力会社およびメンバーマネジメント、予算・リスク管理の一部

■資格

- ・初級システムアドミニストレータ(20××年××月)
- ・日本英語検定試験準1級(20××年××月)

■自己PR

大学院時代から研究をしてきた表面加工プロセス技術を活かしつつ、エッチング装置の開発に携わってきました。開発の中では、他の研究者と強調することを大切にし、お互いのアイデアを率直に意見交換できるよう率先してチームを引っ張ってきました。

以上